高輝度X線源を搭載した
微小部X線回折装置

20 µm照射と高精度ゴニオメーターにより微小領域評価に対応

DicifferX Microarea Edition

DicifferX Microarea Edition の 3 つの特長

1. 2 波長に対応した超高輝度 X 線源
2. 交差精度 ±10 µm 以下を実現する高精度ゴニオメーター
3. SmartLab と同じ検出器・ソフトウェアを採用し、スムーズな運用が可能

微小部解析を、より速く、より正確に

高強度

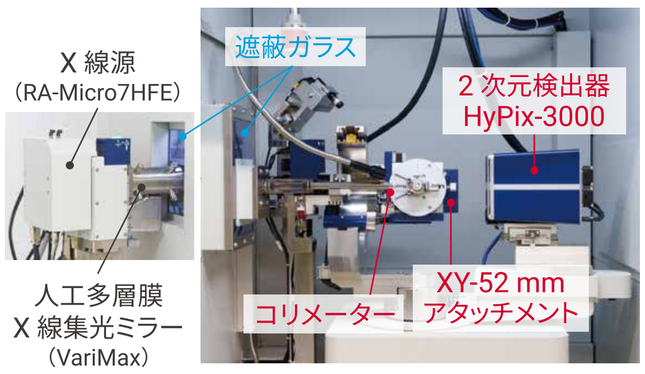
高輝度 X 線源（RA-Micro7HFE)
人工多層膜 X 線集光 ミラー（VariMax)

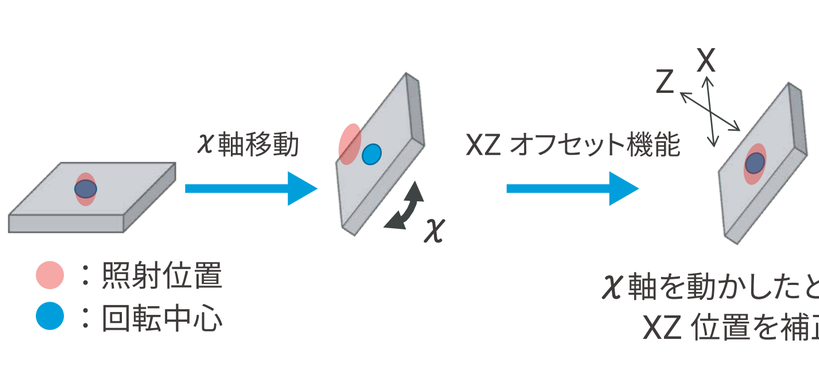
高精度

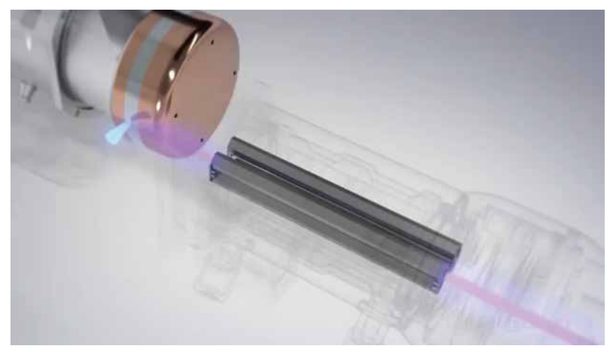
交差精度 ±10 µm 以下
狙った微小領域を正確に測定

選べる 2 波長構成

波長組み合わせ例
Cu–Mo / Cu–Co / Cu–Cr

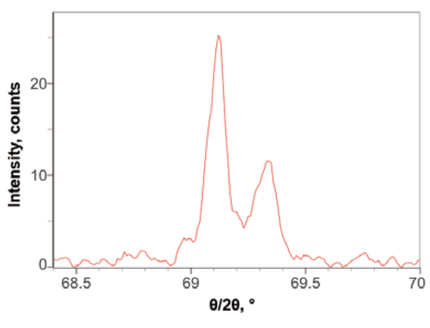


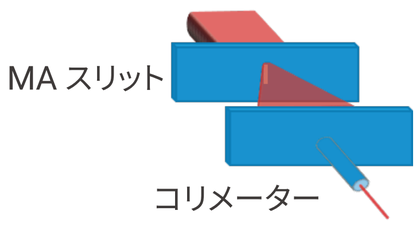




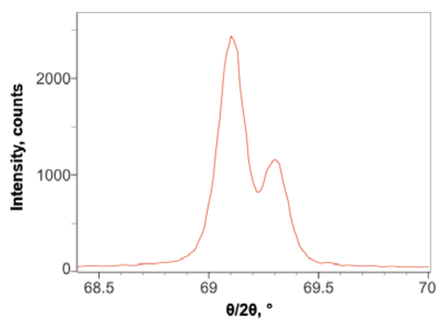
測定時間を大幅短縮

SmartLab 9 kW（ライン線源）
MA0.2 mm + Φ0.1 mm コリメーター



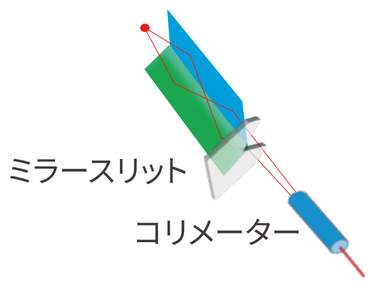


DicifferX Microarea Edition 1.2 kW
Φ0.1 mm コリメーター（高分解能設定）



強度比

1:100

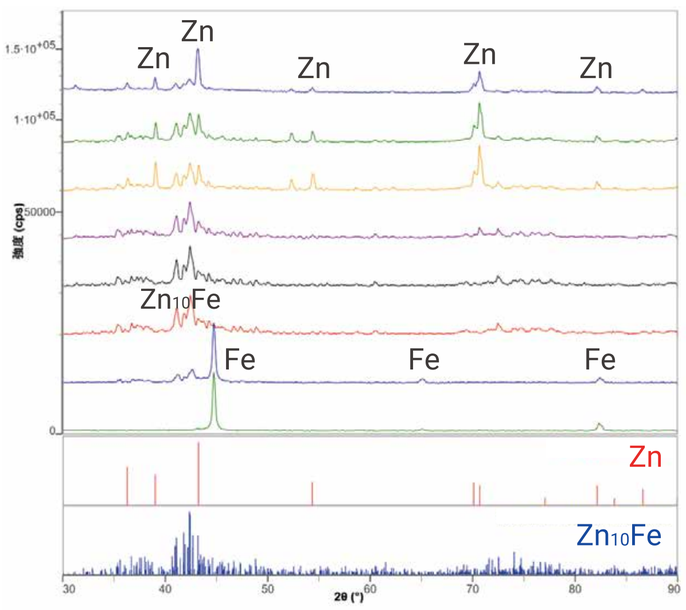


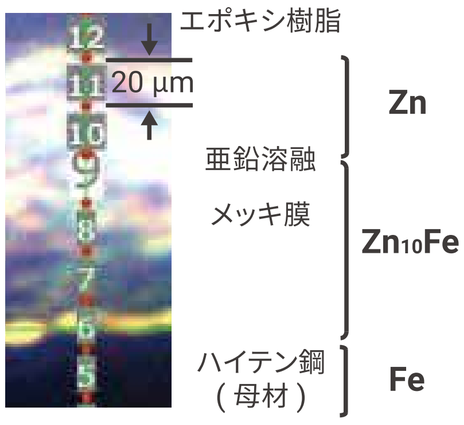
試料 : Si 粉末 NIST 640f、2D スキャンスピード : 10°/min

- 汎用機の微小部光学系と比較して圧倒的な高強度を実現
- 従来 5 時間を要した測定を約 3 分で実施可能

微小領域の結晶相変化を可視化

亜鉛溶融メッキの断面
20 µm でのラインマッピング (定性分析)





- 厚み方向における結晶相の変化を評価可能

Rigaku

rigaku.com

© Rigaku Holdings Corporation and its Global Subsidiaries. All rights reserved.